

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】令和 3 年 4 月 1 日 (2021.4.1)

【公開番号】特開 2020-41989 (P2020-41989A)

【公開日】令和 2 年 3 月 19 日 (2020.3.19)

【年通号数】公開・登録公報 2020-011

【出願番号】特願 2018-171858 (P2018-171858)

【国際特許分類】

G 0 1 N 30/66 (2006.01)

G 0 1 N 27/04 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 30/66

G 0 1 N 27/04 E

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 2 月 5 日 (2021.2.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 5】

そのガスクロマトグラフは、上記の熱伝導度検出器を備える。したがって、ランニングコストを低減することが可能になる。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 4】

他方の流量調整部 5 0 は、制御部 8 0 の制御に基づいて所定流量のキャリアガスを切換弁 6 0 に供給する。切換弁 6 0 は、例えば三方電磁弁であり、流量調整部 5 0 に接続されるとともに、熱伝導度検出器 7 0 の後述する 2 つのキャリアガス導入管路 7 5 , 7 7 に接続されている。切換弁 6 0 は、制御部 8 0 の制御に基づいて流量調整部 5 0 から供給されるキャリアガスをキャリアガス導入管路 7 5 , 7 7 のいずれか一方に供給する。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 8】

第 3 の管路 7 3 には、第 1 のガス導入部 7 3 a、第 2 のガス導入部 7 3 b および第 3 のガス導入部 7 3 c が、この順で並ぶように設けられている。第 1 ~ 第 3 のガス導入部 7 3 a ~ 7 3 c のうち、第 1 のガス導入部 7 3 a は第 1 の管路 7 1 に最も近く、第 3 のガス導入部 7 3 c は第 2 の管路 7 2 に最も近い。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 6 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 6 9 】

キャリアガス導入管路 9 1 は上流端 9 1 u および下流端 9 1 d を有し、ガス流通管路 9 2 は上流端 9 2 u および下流端 9 2 d を有する。ガス流通管路 9 2 は、その下流端 9 2 d に排出口 9 2 e を有する。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 7 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 7 3 】

本実施の形態では、図 3 にドットパターンで示すように、キャリアガス導入管路 9 1、ガス流通管路 9 2 および試料導入管路 7 6 の内面全体に、試料ガスに起因する付着物を除去するための洗浄液に対して耐性を有する第 1 の被膜が形成されている。第 1 の被膜は、洗浄液に対してキャリアガス導入管路 9 1 および試料導入管路 7 6 を形成する材料よりも高い耐性を有する。また、フィラメント F 1 , F 2 に、試料ガスに起因する付着物を除去するための洗浄液に対して耐性を有する第 2 の被膜が形成されている。第 2 の被膜は、洗浄液に対してフィラメント F 1 , F 2 を形成する材料よりも高い耐性を有する。さらに、熱伝導度検出器 7 0 は、ガスクロマトグラフ 1 において、他の構成要素から着脱可能に構成されている。